等离子体表面工程



作者: 杨烈宇主编

出版社:北京:中国科学技术出版社

出版日期: 1991.07

总页数: 272

介绍:版权页有编者:(德)E.布罗奇特:本书内容包括等离子体技术的理论、PVD技术等和等离子体技术在摩擦领域、微电子学方面的应用及等离子体技术在测试和表面分析方面的应用。

说明: 登录教客网 (https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html) 查找全本阅读方式

等离子体表面工程 评论地址: https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html 教客网提供千万本图书阅读地址。

https://www.jiaokey.com/book/detail/10198466.html

书名: 等离子体表面工程